

УДК 621.315.592

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОТЖИГА В ВОДОРОДЕ ЛЕГИРОВАННЫХ БОРОМ ПЛЕНОК а-Si:H НА ИХ ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

И. А. Куроха, М. А. Нальгиева

(кафедра физики полупроводников)

E-mail: ormont@phys.msu.ru

Из спектров пропускания легированных бором пленок а-Si:H вычислены спектральные зависимости коэффициентов преломления и поглощения до и после их высокотемпературного отжига в потоке водорода и определены величины статического коэффициента преломления n_0 и оптической ширины запрещенной зоны E_g . Получено, что n_0 увеличивается от 3.4 до 3.69, а ширина запрещенной зоны E_g уменьшается от 1.82 до 1.52 эВ при увеличении температуры отжига до 650°C. Эти изменения обусловлены уменьшением содержания водорода в пленках до концентраций, меньших 1 ат.%, и в пределах точности эксперимента не зависят от концентрации бора в пленках и начальной концентрации водорода.

Введение

Свойства пленок аморфного гидрированного кремния (a-Si:H) зависят от метода и режима их получения. Было показано [1, 2], что существенным фактором, влияющим на электрические, фотоэлектрические и оптические свойства нелегированных пленок а-Si:H, является температура их получения T_s (температура подложки). Последующие внешние воздействия — световые и тепловые — также влияют на эти свойства. В работах [3–6] было установлено, что отжиг нелегированных пленок а-Si:H в вакууме при температурах T_a выше T_s существенно изменяет их электрические и оптические параметры. Это, в частности, обусловлено тем, что после отжига в результате эфузии водорода изменяется его концентрация в пленках и концентрация оборванных связей (ОС) кремния. При высоких температурах отжига ($T_a > 600$ К) наблюдаются и другие изменения структуры, например образование микрокристаллической фазы в аморфной сетке, что также проявляется в существенных изменениях электрических, фотоэлектрических и других свойств пленок а-Si:H [7].

В работе [8] было исследовано влияние высокотемпературного отжига в потоке водорода на электрические свойства легированных бором пленок. Обнаружено, что высокотемпературный отжиг в потоке водорода приводит к существенному изменению температурной зависимости проводимости легированных бором пленок а-Si:H. В отожженных легированных пленках наряду с зонным вкладом и вкладом прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка по оборванным связям в области промежуточных температур обнаружена прыжковая ε_2 -проводимость, связываемая с прыжковой прово-

димостью по локализованным состояниям вблизи края валентной зоны ε .

Целью настоящей работы было определение влияния высокотемпературного отжига в потоке водорода на оптические свойства легированных бором пленок а-Si:H. Для сравнения были проведены аналогичные исследования на нелегированных пленках.

1. Образцы, методика определения параметров пленок а-Si:H

Исследовались нелегированные и легированные пленки а-Si:H с концентрациями бора $8 \cdot 10^{16}$ см⁻³ (пленки 1–3) и $4 \cdot 10^{18}$ см⁻³ (пленки 4–6). Пленки были выращены на кварцевых подложках соответственно при температурах 300 и 250°C методом осаждения в плазме высокочастотного тлеющего разряда. Концентрация водорода в пленках С_H определялась методом инфракрасной спектроскопии, а полная концентрация атомов бора С_B — методом вторичной ионной спектроскопии. Указанные параметры исследованных неотожженных (1, 4) и отожженных (2, 3, 5, 6) пленок приведены в таблице. Толщина пленок, определенная по скорости и времени их роста, составляла 1 мкм. Отжиг пленок проводился в потоке водорода при температурах 600 и 650°C в течение 30 мин.

На спектрофотометре UV 5270 «Beckman» при комнатной температуре измерялись спектры пропускания структуры тонкая пленка а-Si:H — толстая прозрачная подложка.

Спектры пропускания исследованных структур в области длин волн, сравнимых с толщиной пленок, имеют осциллирующий характер вследствие эффекта интерференции света. В работе [9] показано, что для оптически однородной пленки на толстой прозрачной подложке величина и спек-

Пленка	T_a , °C	T_s , °C	C_H , ат.%	C_B , см ⁻³	n_0	E_g , eV
1	—	300	10	$8 \cdot 10^{16}$	3.44	1.79
2	600	300	< 1	$8 \cdot 10^{16}$	3.67	1.54
3	650	300	< 1	$8 \cdot 10^{16}$	3.68	1.52
4	—	250	13	$4 \cdot 10^{18}$	3.40	1.82
5	600	250	< 1	$4 \cdot 10^{18}$	3.67	1.57
6	650	250	< 1	$4 \cdot 10^{18}$	3.69	1.56
7	—	250	9	—	3.5	1.75
8	600	250	< 1	—	3.68	1.53
9	—	200	—	—	3.42	1.8
10	—	300	—	—	3.53	1.75
11	—	400	—	—	3.6	1.7

тральная зависимость коэффициента преломления $n(\lambda)$ в области прозрачности и слабого поглощения пленки вычисляются из спектров пропускания $T(\lambda)$ по формуле

$$n(\lambda) = \left[N + (N^2 - n_s^2)^{1/2} \right]^{1/2}, \quad (1)$$

где

$$N = 2n_s \frac{T_M - T_m}{T_M T_m} + \frac{n_s^2 + 1}{2},$$

T_M , T_m — относительные величины пропускания в максимумах и минимумах спектра, а n_s — показатель преломления подложки. Величины коэффициентов преломления определялись с точностью до 1%.

Согласно работе [10], заключение об однородности пленки можно сделать по спектру пропускания структуры. Для однородной пленки в области ее прозрачности величины T_M и T_m постоянны и максимум пропускания структуры равен величине пропускания подложки T_s , вычисленной по формуле, приведенной в работе [9]:

$$T_s = \frac{2n_s}{n_s^2 + 1}. \quad (2)$$

В области слабого поглощения однородной пленки T_M и T_m уменьшаются с уменьшением λ . Для неоднородной пленки в области прозрачности величины T_M не совпадают со значением T_s , а T_m в области слабого поглощения увеличивается с уменьшением λ .

Спектры пропускания всех исследованных нами пленок свидетельствуют о достаточной их однородности, что обусловливалось высокой температурой получения, когда скорость роста пленок мала. Поэтому расчет коэффициентов преломления исследованных пленок в области прозрачности и слабого поглощения проводился по формуле (1).

Как показано в работе [9], в области сильного (межзонного) поглощения, где $T(\lambda) < 0.2$, интерфе-

ренция практически отсутствует и коэффициент поглощения пленки $\alpha(h\nu)$ определяется соотношением

$$\alpha(h\nu) = -\frac{1}{d} \ln \left[(n(\lambda) + 1)^3 (n(\lambda) + n_s^2) \cdot \frac{T}{16} n_s (n(\lambda))^2 \right], \quad (3)$$

где d — толщина пленки, T — относительная величина пропускания, n и n_s — показатели преломления пленки и подложки.

Величины $n(\lambda)$ в области сильного поглощения определялись нами путем экстраполяции зависимости $n(\lambda)$, найденной нами для области прозрачности и слабого поглощения, в эту область длии волн.

Оптическая ширина запрещенной зоны E_g исследованных пленок а-Si:H определялась по методу Тауца [11] из найденной нами спектральной зависимости $\alpha(h\nu)$ в области межзонного поглощения. Точность измерения величины E_g составляла 3%.

2. Результаты измерений

На рис. 1 показаны типичные спектры пропускания $T(\lambda)$ исследованных неотожженной и отожженной структур с концентрацией бора в пленке $4 \cdot 10^{18}$ см⁻³. Видно, что величины максимумов пропускания T_M неотожженной структуры в области длинных волн совпадают с величиной пропускания подложки T_s (горизонтальная линия), вычисленной при $n_s = 1.51$. Это означает, что неотожженная пленка прозрачна в области длинных волн и, следовательно, оптически однородна.

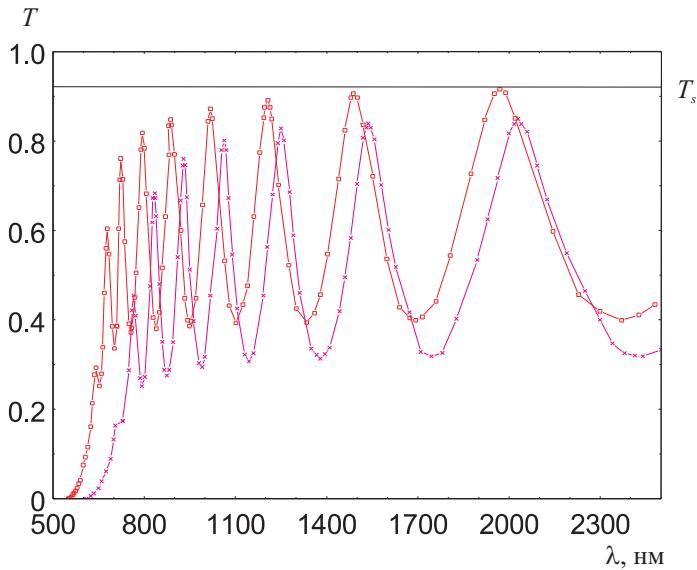


Рис. 1. Спектры пропускания структур с неотожженной пленкой 4 (квадраты) и отожженной пленкой 6 (крестики)

Из рисунка видно, что спектры отожженной и неотожженной пленок различны. В исследованном интервале длин волн в спектре отожженной структуры величины T_M меньше T_s , т.е. у пленки нет области прозрачности. Это может быть обусловлено уменьшением ширины запрещенной зоны

и увеличением концентрации ОС кремния после высокотемпературного отжига. На уменьшение ширины запрещенной зоны указывает сдвиг края пропускания в длинноволновую область. Уменьшение величины T_M может быть обусловлено возникающей в отожженной пленке оптической неоднородностью — изменением коэффициента преломления по толщине пленки. Однако в спектре оптически неоднородной пленки в области слабого поглощения T_m увеличивается с уменьшением длины волны. Этого не наблюдается в спектрах пропускания всех исследованных отожженных пленок, что позволяет нам сделать заключение об оптической однородности отожженных пленок и возможности применения формулы (1) для вычисления их коэффициента преломления.

На рис. 2 приведены величины $n(\lambda)$ для неотожженных и отожженных пленок (1–8), вычисленные в области прозрачности и слабого поглощения по формуле (1). Сплошные кривые соответствуют зависимостям

$$n(\lambda) = \frac{a}{\lambda^2} + n_0, \quad (4)$$

где a и n_0 — параметры пленок. Значения n_0 для всех исследованных пленок приведены в таблице.

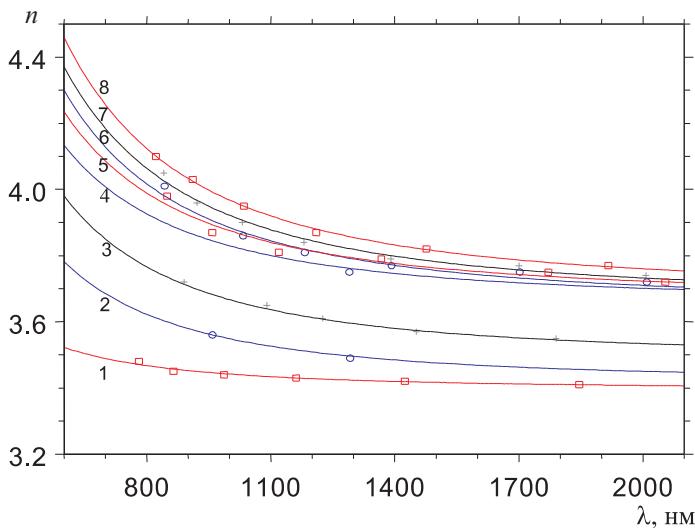


Рис. 2. Зависимости коэффициентов преломления n от длины волны в области слабого поглощения для пленок 1–8: кривые 1–3 — неотожженные пленки 1 (○), 4 (□) и 7 (+); кривые 4–8 — отожженные пленки 2, 3 (○), 5, 6 (□) и 8 (+). Сплошная линия соответствует зависимости $n(\lambda) = a/\lambda^2 + n_0$

На рис. 3 приведены спектральные зависимости коэффициентов поглощения $\alpha(h\nu)$ всех исследованных пленок для области межзонных переходов в координатах Тауца. Значения $\alpha(h\nu)$ рассчитывались по формуле (3). Величины коэффициентов преломления для этой области длин волн находились путем экстраполяции найденной зависимости $n(\lambda)$ для области слабого поглощения, описываемой

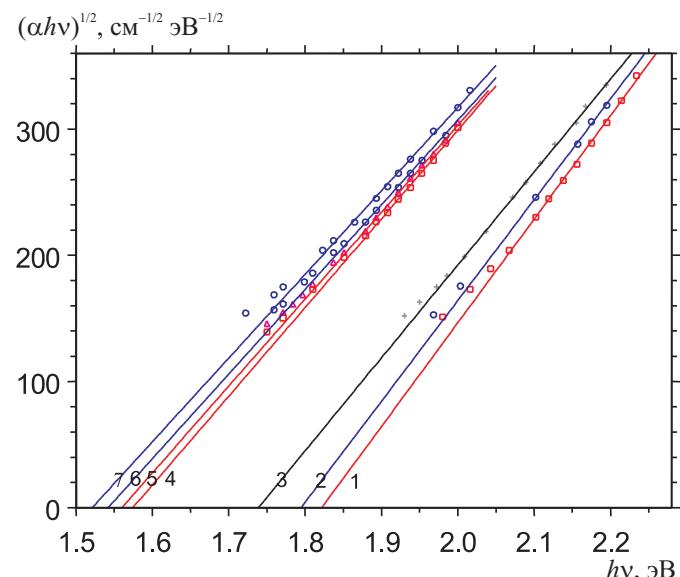


Рис. 3. Зависимости $(\alpha \cdot h\nu)^{1/2}$ от $h\nu$ для пленок 1–7: кривые 1–3 — неотожженные пленки 1 (○), 4 (□) и 7 (+); кривые 4–7 — отожженные пленки 2, 3 (○) и 5, 6 (□)

формулой (4). Экстраполяция линейных зависимостей $(\alpha \cdot h\nu)^{1/2}$ от $h\nu$ к нулю дает значения оптических ширин запрещенной зоны E_g , которые приведены в таблице.

3. Обсуждение результатов измерений

Из таблицы видно, что ширина запрещенной зоны E_g и коэффициент преломления n_0 имеют различные значения в разных исследованных пленках. В работе [2] показано, что значение n_0 в пленках a-Si:H определяется концентрацией водорода C_H в них: n_0 увеличивается с уменьшением C_H . Ширина запрещенной зоны E_g , напротив, уменьшается с уменьшением C_H . Как видно из таблицы, значения E_g и n_0 в неотожженных пленках (1, 4, 7) коррелируют с этой зависимостью: при уменьшении C_H величина E_g уменьшается, а n_0 увеличивается.

После отжига пленок величины n_0 существенно увеличились, а E_g уменьшились (см. таблицу). Это может указывать на то, что в пленках значительно уменьшилась концентрация водорода. Была проведена оценка концентрации водорода в отожженных пленках методом инфракрасной спектроскопии. Оказалось, что концентрация водорода в пленках уменьшилась до величин, меньших 1 ат.%, что исключило возможность ее точного измерения.

На рис. 4 приведена зависимость n_0 от E_g для исследованных пленок 1–8. Здесь же приведены данные $n_0(E_g)$ для неотожженных нелегированных пленок 9–11, полученных при высоких температурах подложки и исследованных в работе [12]. Видно, что точки $n_0(E_g)$ для неотожженных нелегированных (7, 9–11) и легированных (1, 4) пленок ложатся

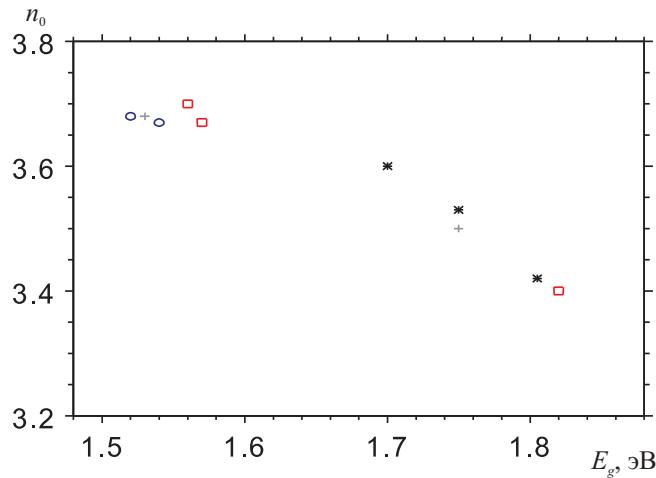


Рис. 4. Зависимость $n_0(E_g)$ для неотожженных (1, 4, 7, 9–11) и отожженных (2, 3, 5, 6, 8) пленок: 1–3 (○), 4–6 (□), 7, 8 (+) и 9–11 (*).

на одну кривую, что определяется изменением концентрации водорода в этих пленках из-за различий в технологических режимах их получения.

Из рис. 4 видно также, что в отожженных пленках (2, 3, 5, 6, 8) величины n_0 существенно увеличились, а E_g уменьшились по сравнению с их величинами в неотожженных пленках. Это связано с тем, что существенно уменьшилась концентрация водорода в них (от $C_H = 13\text{--}9\%$ до величин $C_H < 1\%$). Величины n_0 в отожженных пленках 2, 3, 5, 6, 8 различаются меньше, чем на 1%, что лежит в пределах точности измерения. Значения ширины запрещенной зоны E_g в этих пленках также различаются на величины, лежащие в пределах точности измерений, равной 3%.

Таким образом, в отожженных при высоких температурах пленках ширина запрещенной зоны E_g и коэффициент преломления n_0 не зависят от концентрации бора и начальной концентрации водорода.

Авторы выражают глубокую благодарность за помощь в работе и внимание А. Г. Казанскому и И. П. Звягину за обсуждение результатов работы.

Литература

1. Meiling H., Lenling W., Bezemer J., Wan Der Weg F. // Phil. Mag. B. 1990. **62**, P. 19.
2. Yamaguchi M., Morigaki K. // Phil. Mag. B. 1999. **79**, P. 387.
3. Казанский А.Г., Миличевич Е.П. // ФТП. 1989. **23**, С. 2027.
4. Mitra S., Gleason K.K., Jia H., Shinar J. // Phys. Rev. B. 1993. **48**. P. 2175.
5. Курова И.А., Лупачева А.Н., Мелешко И.В., Ларина Э.В. // ФТП. 1994. **28**. С. 1092.
6. Курова И.А., Ормонт Н.Н., Теруков Е.И. и др. // ФТП. 2001. **35**. С. 367.
7. Афанасьев В.П., Гудовских А.С., Теруков Е.И., Трапезникова И.Н. // ФТП. 2002. **36**. С. 238.
8. Курова И.А., Ормонт Н.Н., Нальгиева М.А. // Вестн. Моск. ун-та. Физ. Астрон. 2005. № 4. С. 54.
9. Swanepoel R. // J. Phys. E. 1983. **16**. P. 1214.
10. Swanepoel R. // J. Phys. E. 1984. **17**. P. 896.
11. Tauc J., Grigorivici R., and Vancu A. // Phys. Status Solidi. 1966. **15**. P. 627.
12. Myburg G., Swanepoel R. // Non-Crystalline Solids. 1987. **96**. P. 15.

Поступила в редакцию
13.07.05